

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 03073436 A

(43) Date of publication of application: 28.03.91

(51) Int. CI

G11B 7/24

(21) Application number: 02110060

(22) Date of filing: 27.04.90

(30) Priority:

08.05.89 JP 01113715

(71) Applicant:

HITACHI LTD HITACHI MAXELL

LTD

(72) Inventor:

ANDO KEIKICHI TERAO MOTOYASU TAMURA NORIHITO MIYAUCHI YASUSHI **NISHIDA TETSUYA**

OTA NORIO

(54) MEMBER FOR INFORMATION RECORDING

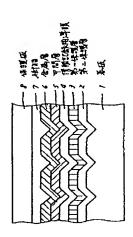
(57) Abstract:

PURPOSE: To prevent the deformation of a substrate by the irradiation heat of a beam for recording by providing 1st and 2nd protective layers essentially consisting of a specific oxide, sulfide or nitride in proximity to a thin film for recording.

CONSTITUTION: The thin film 4 for information recording which is formed on the substrate 1 and generates a change by receiving the irradiation with a beam for recording is provided. The 1st protective layer 3 which consists of at least one material selected from the materials essentially consisting of the oxide, sulfide or selenide having the thermal conductivity ranging 3 0.5 W/m.K and 2 6W/m.K and exists on the side near the thin film 4 for informa tion recording is provided in proximity to the thin film 4 for information record ing. The 2nd protective layer 2 which consists of at least one material selected from the materials essentially consisting of the oxide, carbide or nitride having the thermal conductivity ranging 3 8W/m.K and 2 50W/m.K is provided. The change in the shape on the substrate surface by a laser beam for recording is prevented in

this way and the degradation in the recording sensitivity is prevented.

COPYRIGHT: (C)1991,JPO&Japio



BEST AVAILABLE COPY

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

® 公 開 特 許 公 報(A) 平3-73436

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)3月28日

G 11 B 7/24.

В 8120-5D

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

の発明の名称 情報記録用部材

> ②符 顔 平2-110060

頤 平2(1990)4月27日 @出

⑩平1(1989)5月8日30日本(JP)30特願 平1-113715 優先権主張

東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製

作所中央研究所内

⑫発 明 元 康 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製

作所中央研究所内

明 大阪府茨木市丑寅1丁目1番88号 日立マクセル株式会社 ⑫発 仁

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

勿出 願 人 日立マクセル株式会社 大阪府茨木市丑寅1丁目1番88号

19代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

最終頁に続く

明者

1. 発明の名称 情权記錄用部材

- 2. 特許請求の範囲
 - 1、 基板上に形成された記録用ビームの照射を受 けて変化を生ずる情報記録用薄膜を有する記録 媒体において、上記情報記録用薄膜に近接して、 もしくは上記の情報記録用薄膜に隣接して熱伝 導率が0.5W/m・K以上6W/m・K以下 の範囲の酸化物、硫化物あるいはセレン化物を 主成分とする材料より選ばれた少なくとも一者 からなり、上記情報記録用薄膜に近い餌に有る 第一保護層と、熱伝導率が8W/m・K以上 50W/m・K (Kは絶対温度)以下の酸化物、 炭化物あるいは窒化物を主成分とする材料より 週ばれた少なくとも一者からなる第二保護層を 有することを特徴とする記録用部材。
 - 2、第一保護層がSiO, SiO, TiO, ZrO. およびZnS, CdS, In,S,, Zn Se, Cd SeおよびIn,Se,より成る

A群より遊ばれた少なくとも一者に近い組成の 材料からなり、第二保護層がAe.O。。 Ta,O,, Y,O,, Si,N., A&N, SiC, およびARSiN.などのAR-Si-N系材 料およびA1-Si-O-N系材料より成るB 群より選ばれた少なくとも一者に近い組成の材 料からなることを特徴とする請求項1記載の記 舜用部材。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明はレーザー光などの記録用エネルギービー ムによって、たとえば映像や音声などのアナログ 信号をFM変調したものや、電子計算機のデータ や、ファクシミリ信号やディジタルオーディオ信 号などのディジタル情報を、リアルタイムで記録 することが可能な情報の記録用部膜に関する。

【従来の技術】

レーザー光によって薄膜に記録を行う記録原理 は種々あるが、膜材料の相転移(相変化とも呼ば れる)、フォトダークニングなどの原子配列変化

特別平3-73436(2)

による記録は、膜の形状変化をほとんど伴わないので、2枚のディスクを樹脂により直接貼りあわせた両面ディスクが出来るという長所を持っている。この種の記録に関連する公知例としては、例えば特別昭60-226723号が挙げられる。 【発明が解決しようとする課題】

上記従来技術のうち、相変化による記録は記録 用ビームの照射による熱によって膜形状変化をほ とんど伴わない原子配列変化を生じさせるもので あるが、記録膜中に発生し、記録膜に近接した保 護層に伝わった熱によって基板が局部的に型めら れることが無いようにしてやらないと、 基板が変 形し、ノイズが増加したりトラッキングが不安定 になったりする。

従って、本発明の目的は、記録信号に忠実な再生波形が得られ、上記の記録用ビームのレーザー光が基板の表面の形状の変化により、散乱されない、また、上記の酸化物、硫化物、炭化物あるいは窒化物を主成分とする薄膜の熱伝導によって記録感度が低下しにくい記録用部材を提供すること

くとも一者との混合材料を、第二保護層として Si,N.,ALSiN,あるいはAL,O,に近い 組成の材料を用いる。

第一保護層の酸化物、炭化物、あるいは硫化物 を主成分とする薄膜は、熱伝導率が6W/m・K (Kは絶対温度)以下の範囲が好ましく、膜厚は 10 nm以上1000nm以下の範囲が好ましい。 特に、然伝導率が2W/m·K以上5W/m·K 以下、膜厚が約50mm以上300mm以下の酸 化物、硫化物あるいは窒化物を主成分とする薄膜 を用いると、上記の記録用ビームの照射によって 生ずる変質あるいは変形を防止する効果が顕著で ある。熱拡散係数は 0 、 4 6 cm*/sec以上 1. 15 c m */s e c 以下が好ましい。上記の 第二保護層の酸化物、炭化物、あるいは窒化物を 主成分とする薄膜は、熱伝導率が8W/m・K以 上60W/m・K以下の範囲が好ましく、膜厚は 10 nm以上1000 nm以下の範囲が好ましい。 特に、熱伝導率が10W/m・K以上50W/m・ K以下、膜厚が約50nm以上200nm以下の

にある.

【認題を解決するための手段】

上記目的は、装板上に形成された記録用ビーム の照射を受けて変化を生ずる情報記録用辞膜を有 する情報記録用部材において、上記の記録用薄膜 に近接して適当な酸化物、硫化物あるいは窓化物 を主成分とする保護層を多層に設けることにより 遠成される。上記の保護暦を2層とする場合は、 記録膜に近い側の第一保護暦としてはSiO, SiO,, TiO,, ZrO,, ZnS, CdS, In.S., ZnSe, CdSettUIn.Sc. より成るA群より選ばれた少なくとも一者に近い 材料を主成分とする薄膜を、記録膜から違い側の 第二保護間としてはAa.O,, Ta.O,, Y.O,, Si, N., AlN, SiC, BLUAlSiN, などのAI-Si-N系材料およびAI-Si -O-N系材料より成るB群より選ばれた少なく とも一者に近い組成の材料を主成分とする薄膜を 用いる。より好ましくは、第一保護層として ZnSまたはZnSとA群の酸化物のうちの少な

破化物、炭化物、あるいは窒化物を主成分とする

離膜を用いると、記録感度の低下が少ない。熱拡

散係数は2.3 cm³/sec以上6.9 cm³/

sec以下が射ましい。記録膜の膜厚は20nm

以上250nm以下の範囲が記録感度、S/Nに設

などの点で好ましく、第一保護層および第二保護層の膜厚と合せて調整することが好ましい。第一保護層および第二保護層の膜厚の和は10nm以下の膜層および第二保護層の膜厚の和は10nm保護

上1000nm以下の

が好ましい。この再供

を持るために、上記記録膜の膜厚と合せて調整することが好ましい。

一般に確膜に光を照射すると、その反射光は複膜表面からの反射光と薄膜裏面からの反射光と可膜裏面からの反射光との 重ねあわせになるため干渉をおこす。反射率で借 号を読み取る場合には、上記のそれぞれの膜の膜 厚を調整して反射率の値が小さい条件を調たすことが好ましい。これは、借号読みだし時のコント ラスト比が大きくなり、記録感度も高くなるから である。第一保護履および第二保護履の総和の特

特開平3-73436 (3)

に好ましい腹厚範囲は80ヵm以上600ヵm以 下の範囲である。記録膜の屈折率と膜厚の積は 100 n m 以上、600 n m 以下、第一保護層お よび第二保護層の屈折率と膜厚の積の総和は 120 n m 以上、1500 n m 以下の範囲が特に 好ましい。ただし、記録膜については、記録膜の 少なくとも一部分の屈折率と膜厚の積が上記の範 **囲内にあればよい。これらの屈折率と膜厚の積の** 好ましい範囲は、本発明に含まれない低熱伝導率 の酸化物、硫化物あるいはセレン化物を主成分と する保護層あるいは高熱伝導率の酸化物、炭化物 あるいは窓化物を主成分とする保護層を設ける場 合にも有効である。第一保護層および第二保護層 は使用するレーザ光の消疫係数kが0.03以上 1. 0以下であると、記録感度が高く好ましい。 第一保護層および第二保護層とは反対側(光入射 傾の反対側)の保護層(反射層を設ける場合は記 緑膜と反射層との間の層)にも第一保護層および 第二保護層に用いるものに近い組成の物質を使用 でき、また、同じように多層にすることもできる

が、消費係数は 0 . 1 以下が好ましいので、例えば酸化物の場合、酸素欠陥を少なくする方がよい。上記の光入射側とは反対側の酸化物、硫化物および窒化物を主成分とする溶膜に近接してさらに上記の第一保護層および第二保護層に使用可能な材料の層や金属層を設ければさらに強度が増す。本発明の酸化物、硫化物および窒化物を主成分とする溶膜は、記錄膜と基板との間に形成してもよいし、記錄膜の基板とは反対の側に設けてもよい。間側に設ければさらに好ましい。基板は光入射側でもその反対側にあっても良い。

記録膜の光入射側と反対側の保護層と、それに 隣接する金属層との間に、W、Mo、Crのうち の少なくとも一元素を主成分とする接着性改資層 を設ければさらに好ましい。この層の膜厚は 1nm以上30nm以下が好ましい。この層を設 けるのは、本発明以外の記録媒体にも有効である。 第一保護層と第二保護層との界面は必ずしも明 確である必要はない。組成が連続的に変化してい

た方が、界面の剥離のおそれがない。また、第一

保護圏および第二保護圏は均一な圏でなくてもよく、例えばそれぞれが多層膜で平均の熱伝導率や 届折率、熱拡散係数が上記の範囲内にあるもので あってもよい。

本発明はディスク状記録媒体ばかりでなく、テープ状、カード状などの記録媒体にも有効である。 また光磁気記録膜など、他の記録原理による記録 媒体にも有効である。

【実施例】

以下、本発明の一実施例を第1回により説明する。まず、案内簿を有する基板1(ポリカーポネート、直径130mm、厚さ1.2mm)に、本発明の第二保護層としてAa,〇,に近い組成の窓化物よりなる薄膜2(約100mm)を積層し、第一保護層として(ZnS)。。(Si〇,)。。に近い組成の薄膜3(約120mm)を積層した後、上記光入射側第二保護層および第一保護層を入して形成した記録用ビームの照射を受けてほとんど変形を伴わないで原子配列変化を生ずるGeーSbーTe系情報記録用薄膜4(厚さ約

30 nm) に (ZnS), (SiO,) , に近い 組成よりなる中間間5(厚さ約210nm)を積 **厄し、さらに金属元素を主成分とする薄膜6とし** TAR-Mg合金の薄膜(約50nm)を積層し た後、無外線の照射により硬化する樹脂フを塗布 し、真空中(約10Pa)で無外線に約2分間露 光し、前記金属元素を主成分とする薄膜 6 ともう 一枚の同じ構造のディスク8を貼りあわせた。次 に、上記の情報記録用薄膜4に基板1側(抵面上 で下方) より記録用レーザビームを照射し、情報 の記録を行った。次に、上記第二保護層の薄膜2 と基板との界面付近を上記基板1個(紙面上で下 方) より顕微鏡 (×400倍) で観察し、上記法 板に変質および変形が生じていないことを確認し た、本実施例の第二保護層のA 4,0,の膜厚を変 化させたとき、記録に必要なレーザパワーと 100回記録書き換え後の反射率変化分を補正し た雑音レベルは次のように変化した。

膜厚(nm) 記録レーザパワー 雑音レベル

特別平3-73436(4)

5	1 0 m W	- 7 5 d B m
1 0	1 3 m W	- 8 0 d B m
5 0	1 5 m W	- 8 3 d B m
1 0 0	1 6 m W	-85 d B m
200	1 7 m W	-85dBm
1 0 0 0	19 m W	- 8 5 d B m
1500	2 2 m W	-85dBm

また、第一保護層の設厚は50nm以上 300nm以下のとき、低いレーザパワーで記録 でき、推音レベルも低い値となった。

また、上記の金属元素を主成分とする薄腹 6 が Auを主成分とする薄膜などの接着性の悪い薄膜 である場合、この膜と中間 PD 5 との間に Mo, W, Crのうちの一者よりなる接着性改良層を設ける と、書き換え可能回数が大幅に向上した。この膜 厚は1 n m 以上30 n m 以下が適当であった。ま た、上記の第一保護層の (ZnS)。。(SiO₂) .。の一部または全部をZnS, CdS, In,S,, Zn Se, Cd Se, In, Se, SiO2, .SiO, TiO,およびZrO,より成るA群より 選ばれた少なくとも一者に近い租成のもので置き 換え、上記の第二保護層のAINの一部または全 部をAl.O., Ta.O., Y.O., Si,N.,A IN, AISIN, AISIN,, Alsi, N., Si-Al-O-N, および SiCより成るB群より選ばれた少なくとも一者 に近い組成の材料を主成分とするもので置き換え ても同様の結果が得られるこれらのうちでは A L . O . およびA L - S i - N 系材料が特に好ま

通りである。

SiO,: 1 W/m·K
ZnS: 2 W/m·K
TiO,: 5 W/m·K
ZrO,: 3 W/m·K
Si,N4:18 W/m·K
A l,O,: 46 W/m·K
Y,O,: 15 W/m·K
A l N:30 W/m·K
SiC: 8 W/m·K

例えば、上記の第一保護層を(2mg)。 (SiO₂)。。、上記の第二保護層をAgSiN。、 または上記の第一保護層をZrO。、上記の第二 保護層をAgSiN。、あるいは、上記の第一保 護層をSiO。、上記の第二保護層をAg。〇。、 もしくは上記の第一保護層をAg。〇。としても 同様の結果が得られた。本実施例の第一保護層の 酸化物、あるいは硫化物を主成分とする薄膜の熱 伝導率は1W/m・K以上6W/m・K以下、上 記の第二保護層の酸化物、あるいは窒化物を主成 分とする薄膜の熱伝導率は8W/m・K以上 60W/m・K以下が好ましく10W/m・K以 上50W/m・K以下が特に好ましい。熱伝導率 の異なる材質を用いた場合、記録レーザパワーと 10°回オーバーライトした時のノイズ増加は次 のように変化した。

男一品温度の発伝資本	記録レーザパワー	消え残り
(∀/m·K)		
6	1 2 m W	6 d B
8	1 2 m W	3 d B
1 0	1 3 m W	OdB
3 0	1 4 m W	ОфВ
5 0	1 5 m W	0 d B
6 0	17 mW	0 d B
7 0	1 9 m W	0 d B

特別平3-73436 (5)

と膜厚の積が100mm以上、600mm以下、中間層の届折率と膜厚の積が50mm以上、600mm以上、600mm以上、600mm以上、600mm以上、600mm以上、600mm以上、600mm以上、600mm以上、600mm以上、600mm以上、600mm以上、600mmmを開発の積が上記の範囲内に有るようにしてもとして、600mmを形成しない場合は、記録の度が約50%低下するが、他の特性に大きな変化は無く、使用可能であった。

また、記録膜の非晶質に近い状態の部分の扇折率

第2図に示したように、ガラス基板10上に形成した紫外線硬化樹脂層11の表面に案内薄を形成し、その上に第1回のディスクと同様な記録層を順序を逆に(金属元素を主成分とする薄膜6から)構成し、もう一枚のディスクと貼り合せずの分別でも、ほぼ同様な効果が得られた。このが好ましい。ただし、これらの場合はレーザ光は基板とは反対の側から入射させた。

第3図に示すように、従来は10°回の情報の 書き換えによって雑音レベル(図中B)が約

. 図面の簡単な説明

第1回は案内牌を有する、基板を用いて本発明の記録用部材の一実施例の構成を示す断面図、第2回は案内牌を有する樹脂を設けた基板を用いて本発明の記録用部材の一実施例の構成を示す断面図、第3回は本発明の記録用部材による情報の書換え回数に対する雑音レベルの変化を示す図である。第4回は複数のターゲットを用いて本発明の記録用部材の構成を作製する方法の一実施例を示

【発明の効果】

本発明によれば、レーザー光などの記録用ビームを記録用薄膜に照射して情報を記録しても、上記記録用ビームの照射によって生ずる熱は、上記第二保護層である熱伝導率の高い酸化物、炭化物、あるいは窒化物を主成分とする薄膜によって拡散

す断面図.

1 … 案内溝を有する基板、 2 、 1 6 … 第二保護層、 3 、 1 7 … 第一保護層、 4 、 1 4 … 情報記録用部膜、 5 、 1 3 … 中間層、 6 、 1 2 … 金属元素を主成分とする神膜、 7 、 1 7 … 樹脂、 8 、 1 8 … ディスク、 1 1 … 案内溝を有する樹脂、 1 9 … 第一保護層用ターゲット、 2 0 … 第二保護層用ターゲット、 2 1 … 基板、 2 2 … 基板の移動を示す矢印、 2 3 … スパッタ室、 A … 本発明の姓音レベル、 B … 従来の姓音レベル。

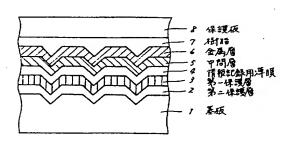
代理人 弁理人 小 川 脇

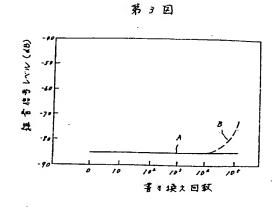




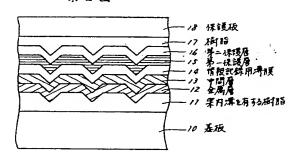
特開平3-73436 (6)

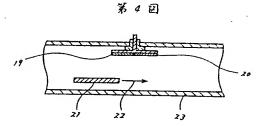
第1回





第2回





第1頁の続き

@発 明 宫 内 靖 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 作所中央研究所内 @発 西 田 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 也 作所中央研究所内 @発 明 者 太 田 大阪府茨木市丑寅1丁目1番88号 日立マクセル株式会社

BEST AVAILABLE COPY

THIS PAGE BLANK (USPTO)